

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|---|----|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 主動式可調變電流之薄膜電晶體結構 | 台灣 | 095109191 | I300273 | 2006-03-17 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | 2026-03-16 |
| 以光阻熱回流處理技術於半導體基板上形成圖形的方法 | 台灣 | 097149988 | I420570 | 2008-12-22 | 2013-12-21 | 2013-12-21 | 2028-12-21 |
| 靜態隨機存取記憶體裝置 | 台灣 | 098125793 | I419173 | 2009-07-31 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2029-07-30 |
| 靴帶式驅動電路 | 台灣 | 99140596 | I401885 | 2010-11-24 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2030-11-23 |
| 獨立閘極控制靜態隨機存取記憶體 | 台灣 | 100138258 | I476768 | 2011-10-21 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2031-10-20 |
| ELECTRODEPOSITED NANO-TWINS COPPER LAYER AND METHOD OF FABRICATING THE SAME | 美國 | 15/238,345 | US 10,094,033 B2 | 2016-08-16 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2033-02-24 |
| 薄膜塗佈方法 | 台灣 | 102118011 | I463264 | 2013-05-22 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2033-05-21 |
| 閘極堆疊結構及包含其之金屬氧化物半導體元件及閘極堆疊結構之製造方法 | 台灣 | 101145311 | I505468 | 2012-12-03 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2032-12-02 |
| 柵極堆迭結構的製造方法 | 大陸 | 201210543673.2 | CN103855195B | 2012-12-13 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2032-12-13 |
| 增強型氮化鎵電晶體及其形成方法 | 台灣 | 102118636 | I497721 | 2013-05-27 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2033-05-26 |
| Enhanced GaN Transistor and the Forming Method Thereof | 美國 | 14/050,534 | US 9,240,474 B2 | 2013-10-10 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2033-10-10 |
| 用于太阳能照明与能源生成的日光调控装置 | 大陸 | 201921370146.X | CN210514771U | 2019-08-22 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2029-08-21 |
| 非揮發性電阻式記憶體及其操作 | 台灣 | 104124275 | I560715 | 2015-07-27 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2035-07-26 |
| A NONVOLITILE RESISTANCE MEMORY AND ITS OPERATION THEREOF | 美國 | 14/809,280 | US 9,336,869 B2 | 2015-07-27 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2035-07-27 |
| 記憶體陣列電路 | 大陸 | 201510450091.3 | CN105304126B | 2015-07-28 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2035-07-28 |
| 一種反及型態阻變式快閃記憶體電路及操作 | 台灣 | 104124082 | I555248 | 2015-07-24 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2035-07-23 |
| NAND TYPE VARIABLE RESISTANCE RANDOM ACCESS MEMORY AND METHODS | 美國 | 14/807,899 | US 9,548,398 B2 | 2015-07-24 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2035-07-24 |
| 一種反及型態阻變式快閃記憶體電路及操作 | 大陸 | 201510441961.0 | CN105304669B | 2015-07-24 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2035-07-24 |
| 具視力補償之頭戴式顯示裝置 | 台灣 | 104130344 | I591379 | 2015-09-14 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2035-09-13 |
| 線路結構及其製備方法 | 台灣 | 104139841 | I569391 | 2015-11-30 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2035-11-29 |
| 智慧型眼鏡之電療裝置及其控制方法 | 台灣 | 104130667 | I591398 | 2015-09-16 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2035-09-15 |
| METHOD FOR PARAMETER EXTRACTION OF A SEMICONDUCTOR DEVICE | 美國 | 15/351,626 | US 10,345,371 B2 | 2016-11-15 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2038-03-01 |
| 無線充電裝置 | 台灣 | 107147273 | I671972 | 2018-12-26 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2038-12-25 |
| WIRELESS CHARGING DEVICE | 美國 | 16/360,346 | US 10,978,902 B2 | 2019-03-21 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2039-10-24 |
| 光学感測器 | 大陸 | 201910028174.1 | CN110554032B | 2019-01-11 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2039-01-11 |
| 光學感測器 | 台灣 | 107118936 | I679413 | 2018-06-01 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2038-05-31 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|---|----|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 無參考訊號源時脈資料回復系統及其頻率偵測器 | 台灣 | 107141379 | I681635 | 2018-11-21 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2038-11-20 |
| 電控變焦的消色差透鏡 | 台灣 | 107135035 | I676071 | 2018-10-04 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2038-10-03 |
| ELECTRICALLY TUNABLE FOCUSING ACHROMATIC LENS | 美國 | 16/284,548 | US 10,718,989 B2 | 2019-02-25 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2039-02-24 |
| 具有奈米雙晶銅之電連接結構及其形成方法 | 台灣 | 108125724 | I686518 | 2019-07-19 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2039-07-18 |
| ELECTRICAL CONNECTING STRUCTURE HAVING NANO-TWINS COPPER AND METHOD OF FORMING THE SAME | 美國 | 16/836,955 | US 11,145,619 B2 | 2020-04-01 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2040-04-01 |
| 具有纳米双晶铜的电连接结构及其形成方法 | 大陸 | 201910941374.6 | CN112242311B | 2019-09-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2039-09-30 |
| ELECTRICAL CONNECTING STRUCTURE HAVING NANO-TWINS COPPER | 美國 | 17/447,294 | US 11,715,721 B2 | 2021-09-10 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2040-07-15 |
| 近眼擴增實境裝置 | 台灣 | 107147361 | I687745 | 2018-12-27 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2038-12-26 |
| NEAR-EYE AUGMENTED REALITY DEVICE | 美國 | 16/405,155 | US 10,690,926 B1 | 2019-05-07 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2039-05-06 |
| 近眼擴增實境裝置 | 台灣 | 108143194 | I687746 | 2018-12-27 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2038-12-26 |
| 取樣保值電路及其數位類比轉換器 | 台灣 | 108118849 | I688219 | 2019-05-30 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2039-05-29 |
| 微型化感測探針及其製造方法 | 台灣 | 108114558 | I695174 | 2019-04-25 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2039-04-24 |
| MINIATURIZED SENSING PROBE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | 美國 | 16/671,652 | US 11,452,472 B2 | 2019-11-01 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2041-03-24 |
| 雲母片上異質磊晶半導體材料之製程方法 | 台灣 | 108102085 | I698915 | 2019-01-18 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2039-01-17 |
| METHOD FOR FABRICATING HETEROEPITAXIAL SEMICONDUCTOR MATERIAL ON A MICA SHEET | 美國 | 16/386,779 | US 10,930,496 B2 | 2019-04-17 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2039-04-17 |
| 閘極驅動器 | 台灣 | 106215687 | M555481 | 2017-10-24 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 2027-10-23 |
| 三閘極場效電晶體 | 台灣 | 108102436 | I697121 | 2019-01-22 | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2039-01-21 |
| 可撓式生理感測裝置 | 台灣 | 108120360 | I743491 | 2019-06-12 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2039-06-11 |
| 單晶三族氮化物的形成方法 | 台灣 | 108102615 | I703243 | 2019-01-23 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2039-01-22 |
| 矽晶片太陽能電池及其製造方法 | 台灣 | 108128367 | I699018 | 2019-08-08 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2039-08-07 |
| 半導體製程結果預測方法 | 台灣 | 108116896 | I713085 | 2019-05-16 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2039-05-15 |
| 垂直堆疊型互補式薄膜電晶體 | 台灣 | 110145689 | I805116 | 2021-12-07 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2041-12-06 |
| THIN-FILM TRANSISTOR DEVICE | 美國 | 18/045,878 | US 12,432,983 B2 | 2022-10-12 | 2025-09-30 | 2022-10-12 | 2043-10-31 |
| 單閘極驅動控制的同步整流降壓轉換器 | 台灣 | 110134909 | I780918 | 2021-09-17 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2041-09-16 |
| 一種用於量測待測物的複介電係數的裝置、以及用於複合介電質的時域多重反射訊號的量測裝置及其量測方法 | 台灣 | 110147291 | I805131 | 2021-12-16 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2041-12-15 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|--|----|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| DEVICE FOR MEASURING COMPLEX DIELECTRIC PERMITTIVITY OF A MATERIAL-UNDER-TEST, MEASURING DEVICE FOR MULTIPLE REFLECTIONS OF TIME-DOMAIN SIGNALS OF A COMPLEX DIELECTRIC AND MEASURING METHOD THEREOF | 美國 | 17/748,314 | US 11,815,484 B2 | 2022-05-19 | 2023-11-14 | 2022-05-19 | 2042-05-19 |
| 晶體振盪器及其製作方法 | 日本 | JP2022-044564 | 特許7521731 | 2022-03-18 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2042-03-18 |
| CRYSTAL OSCILLATOR, AND METHOD FOR MAKING THE SAME | 美國 | 17/898,747 | US 11,942,897 B2 | 2022-08-30 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2042-08-30 |
| 晶體振盪器及其製作方法 | 台灣 | 110132308 | I 776661 | 2021-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2041-08-30 |
| 晶體振盪器及其製作方法 | 大陸 | 202211008778.8 | CN115733456B | 2022-08-22 | 2025-08-15 | 2022-08-22 | 2042-08-22 |
| CRYSTAL OSCILLATOR, AND METHOD FOR MAKING THE SAME | 歐盟 | 22191657.0 | EP4152610B1 | 2022-08-23 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2042-08-23 |
| CRYSTAL OSCILLATOR, AND METHOD FOR MAKING THE SAME | 歐盟 | 22191660.4 | EP4152611B1 | 2022-08-02 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2042-08-23 |
| 水晶振動子及びその製造方法 | 日本 | JP2022-069634 | 特許 7344490 | 2022-04-20 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2042-04-20 |
| 晶體振盪器及其製作方法 | 台灣 | 110132309 | I759245 | 2021-08-31 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2041-08-30 |
| 微發光二極體陣列裝置的製法及其製品 | 台灣 | 110140787 | I774600 | 2021-11-02 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2041-11-01 |
| 功率模組 | 台灣 | 110141261 | I810702 | 2021-11-05 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2041-11-04 |
| POWER MODULE | 美國 | 17/573,215 | US 11,646,732 B1 | 2022-01-11 | 2023-05-09 | 2022-01-11 | 2042-01-11 |
| 嵌入式深度學習多尺度物件偵測暨即時遠方區域定位裝置及其方法 | 台灣 | 110149226 | I807561 | 2021-12-28 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2041-12-27 |
| Embedded Deep Learning Multi-Scale Object Detection Model Using Real-Time Distant Region Locating Device and Method Thereof | 美國 | 17/696,044 | US 12,094,221 B2 | 2022-03-16 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2043-02-23 |
| 使用毫米波雷達的即時物件運動狀態辨識方法 | 台灣 | 110144263 | I804072 | 2021-11-26 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2041-11-25 |
| REAL TIME OBJECT MOTION STATE RECOGNITION METHOD USING MILLIMETER WAVE RADAR | 美國 | 17/658,131 | US 12,248,055 B2 | 2022-04-06 | 2025-03-11 | 2022-04-06 | 2043-04-14 |
| 具有低電荷分享效應的閘極驅動電路 | 台灣 | 111205683 | M632327 | 2022-05-31 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2032-05-30 |
| MULTI-WAVELENGTH LASER DEVICE FOR PHOTOCOAGULATION SURGERY | 美國 | 18/107,993 | US 12,419,685 B2 | 2023-02-09 | 2025-09-23 | 2023-02-09 | 2044-03-28 |
| 用於光凝手術的多波長雷射裝置 | 台灣 | 111137597 | I817753 | 2022-10-03 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2042-10-02 |
| 雷射驅動器 | 台灣 | 112112078 | I867479 | 2023-03-29 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2043-03-28 |
| 透明薄膜電晶體型光感測元件的製作方法 | 台灣 | 112101153 | I848517 | 2023-01-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2043-01-10 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|--|----|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 同軸體積全像儲存系統 | 台灣 | 96134329 | I354277 | 2007-09-14 | 2011-12-11 | 2011-12-11 | 2027-09-13 |
| 空間光調制器 | 日本 | 2008-183842 | 4810707 | 2008-07-15 | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 2028-07-15 |
| 空間光調制器 | 台灣 | 97121204 | I365363 | 2008-06-06 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2028-06-05 |
| 壓縮反應時間之畫面控制訊號產生方法 | 台灣 | 101148100 | I463473B | 2007-12-10 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2027-12-09 |
| 降低液晶顯示器色分離之顯示方法 | 台灣 | 102101167 | I479472B | 2007-11-05 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2027-11-04 |
| 微型光學讀取裝置 | 大陸 | 200810092526.1 | 777045 | 2008-04-18 | 2011-05-11 | 2008-04-18 | 2028-04-18 |
| 微型光學讀取裝置 | 台灣 | 097112391 | I358728 | 2008-04-03 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 2028-04-02 |
| 二維可控制局部光場區域背光模組之光學元件裝置 | 台灣 | 096140524 | I363224 | 2007-10-29 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 2027-10-28 |
| 具環境光感測功能之液晶顯示器及其方法 | 台灣 | 096145046 | I358570 | 2007-11-27 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 2027-11-26 |
| 微型光學讀取頭光路裝置 | 台灣 | 097108781 | I359420 | 2008-03-13 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2028-03-12 |
| 單端多埠之儲存裝置 | 台灣 | 096139890 | I474333 | 2007-10-24 | 2015-02-21 | 2015-02-21 | 2027-10-23 |
| 三元內容可定址記憶體漏電流截斷裝置 | 台灣 | 96149397 | I349943 | 2007-12-21 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 2027-12-20 |
| 用於全像儲存之灰階權重重心法 | 台灣 | 099101760 | I394151 | 2010-01-22 | 2013-04-21 | 2013-04-21 | 2030-01-21 |
| 感測裝置 | 台灣 | 099114546 | I412026 | 2010-05-06 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2030-05-05 |
| 矽控整流器 | 美國 | 12/013,637 | US 7,582,916 B2 | 2008-01-14 | 2009-09-01 | 2008-01-14 | 2028-01-14 |
| 高負載驅動裝置 | 台灣 | 099120224 | I418148 | 2010-06-22 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2030-06-21 |
| 以史密特觸發器為基礎的鱗狀場效電晶體靜態隨機存取記憶體 | 台灣 | 099123534 | I455129 | 2010-07-16 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2030-07-15 |
| 雙埠次臨界靜態隨機存取記憶體單元 | 台灣 | 100119160 | I470631 | 2011-06-01 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2031-05-31 |
| 可容忍閘極崩毀之功率閘結構 | 台灣 | 099134465 | I443807 | 2010-10-08 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2030-10-07 |
| 電流限制電路裝置 | 台灣 | 101108776 | I439841 | 2012-03-15 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 2032-03-14 |
| 微型顯微鏡及其光學元件的製作方法 | 台灣 | 101116029 | I475253 | 2012-05-04 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2032-05-03 |
| MINIATURE MICROSCOPE AND MANUFACTURING METHOD OF OPTICAL ELEMENT THEREOF | 美國 | 13/872,831 | US 9,933,608 B2 | 2013-04-29 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2033-04-29 |
| 上橋驅動電路 | 台灣 | 101108777 | I465013 | 2012-03-15 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2032-03-14 |
| 上橋式驅動電路 | 台灣 | 101108779 | I469482 | 2012-03-15 | 2015-01-11 | 2015-01-11 | 2032-03-14 |
| 形成一T型閘極結構的方法 | 台灣 | 101101109 | I455212 | 2012-01-11 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2032-01-10 |
| 具有高電子遷移率之氮化鎵電晶體結構 | 台灣 | 101100964 | I458092 | 2012-01-10 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2032-01-09 |
| 包含有具優選方向成長之Cu6Sn5晶粒之電性連接結構及其製備方法 | 台灣 | 101116641 | I476878 | 2012-05-10 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2032-05-09 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|---|----|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Electric connecting structure comprising preferred oriented Cu6Sn5 grains and method for fabricating the same | 美國 | 13/829,256 | US 8,952,267 B2 | 2013-03-14 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2033-07-11 |
| 包含有具優選方向成長之Cu6Sn5晶粒之電性連接結構及其製備方法 | 大陸 | 201210154178.2 | CN103390565B | 2012-05-18 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2032-05-18 |
| 橢圓偏光儀及運用該橢圓偏光儀之橢圓偏光參數量測方法 | 台灣 | 103102899 | I485374 | 2014-01-27 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2034-01-26 |
| Method for growing epitaxies of a chemical compound semiconductor | 美國 | 14/452,608 | US 9,287,122 B2 | 2014-08-06 | 2016-03-15 | 2014-08-06 | 2034-08-06 |
| Method for growing epitaxies of a chemical compound semiconductor | 美國 | 15/063,572 | US 10,049,872 B2 | 2016-03-08 | 2018-08-14 | 2014-08-06 | 2034-08-06 |
| Epitaxies of a chemical compound semiconductor | 美國 | 16/101,568 | US 10,854,446 B2 | 2018-08-13 | 2020-12-01 | 2014-08-06 | 2034-08-06 |
| Epitaxies of a chemical compound semiconductor | 美國 | 17/093,865 | US 11,437,235 B2 | 2020-11-10 | 2022-09-06 | 2014-08-06 | 2034-09-11 |
| Epitaxies of a chemical compound semiconductor | 美國 | 17/873,274 | US 12,062,541 B2 | 2022-07-26 | 2024-08-13 | 2022-07-26 | 2034-08-06 |
| 金屬轉印膜結構及其製法暨有機發光二極體之製法 | 台灣 | 102143190 | I597876 | 2013-11-27 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2033-11-26 |
| 液晶透鏡 | 台灣 | 102141605 | I490557 | 2013-11-15 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2033-11-14 |
| 液晶透鏡 | 美國 | 14/170,843 | US 9,494,834 B2 | 2014-02-03 | 2016-11-15 | 2014-02-03 | 2034-03-07 |
| Structure and formation method of semiconductor device structure | 美國 | 14/994,718 | US 9,577,078 B1 | 2016-01-13 | 2017-02-21 | 2016-01-13 | 2036-01-13 |
| 二維材料的製作方法 | 台灣 | 106111790 | I646670 | 2017-04-07 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2037-04-06 |
| Fabrication Method for Two-Dimensional Materials | 美國 | 15/699,622 | US 10,428,427 B2 | 2017-09-08 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2037-09-07 |
| 二维材料的制作方法 | 大陸 | 201710303263.3 | CN108690953B | 2017-05-03 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2037-05-03 |
| Structure and formation method of semiconductor device structure | 美國 | 15/008,991 | US 9,735,267 B1 | 2016-01-28 | 2017-08-15 | 2016-01-28 | 2036-01-28 |
| ELECTRODELESS LIGHT-EMITTING DIODE DISPLAY AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME | 美國 | 15/896,453 | US 10,553,640 B2 | 2018-02-14 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2037-10-18 |
| 無電極遮光之發光二極體顯示器的結構及其製程 | 台灣 | 106114840 | I676285 | 2017-05-04 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2037-05-03 |
| ELECTRODELESS LIGHT-EMITTING DIODE DISPLAY AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME | 美國 | 15/654,303 | US 10,535,708 B2 | 2017-07-19 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2037-07-18 |
| 無電極遮光的發光二極管顯示器的結構及其工藝 | 大陸 | 201710414069.2 | CN107393428B | 2017-06-05 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2037-06-04 |
| 半導體裝置及製作半導體裝置之方法 | 台灣 | 106106469 | I759282 | 2017-02-24 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2037-02-23 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|--|----|-----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Semiconductor device and manufacturing method thereof | 美國 | 15/214,777 | US 9,837,538 B2 | 2016-07-20 | 2017-12-05 | 2016-07-20 | 2036-07-20 |
| 半導體裝置及其製作方法 | 大陸 | 201710173047.1 | CN107230701B | 2017-03-22 | 2021-10-15 | 2017-03-22 | 2037-03-22 |
| Semiconductor device including a fin structure | 美國 | 15/807,317 | US 10,269,966 B2 | 2017-11-08 | 2019-04-23 | 2016-07-20 | 2036-07-20 |
| NEURAL NETWORK PROCESSING SYSTEM | 美國 | 15/649,340 | US 10,902,317 B2 | 2017-07-13 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2039-07-21 |
| 神经网络处理系统 | 大陸 | 201710455266.9 | CN107341539B | 2017-06-16 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2037-06-15 |
| 製造半導體裝置的方法 | 台灣 | 106113323 | I702637 | 2017-04-20 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2037-04-19 |
| Method of manufacturing a semiconductor device including a ternary alloy layer formed by a microwafe anneal process | 美國 | 15/253,074 | US 10,453,688 B2 | 2016-08-31 | 2019-10-22 | 2016-08-31 | 2036-11-18 |
| 製造半導體裝置的方法 | 大陸 | 201710385165.9 | CN107785249B | 2017-05-26 | 2022-01-18 | 2017-05-26 | 2037-05-26 |
| RESONANT MAGNETIC COUPLING WIRELESS POWER TRANSFER SYSTEM WITH CALIBRATION CAPABILITIES OF ITS INDUCTOR-CAPACITOR RESONANT FREQUENCIES | 美國 | 15/878,778 | US 10,622,841 B2 | 2018-01-24 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2038-10-01 |
| LIGHT EMISSION DIODE WITH FLIP-CHIP STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | 美國 | 15/879,438 | US 10,770,617 B2 | 2018-01-25 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2038-01-24 |
| LIGHT EMISSION DIODE WITH FLIP-CHIP STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | 美國 | 16/935,625 | US 11,349,045 B2 | 2020-07-22 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2038-01-25 |
| 同軸異質整合高光譜系統 | 台灣 | 107101739 | I662261 | 2018-01-17 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2038-01-16 |
| POST-QUANTUM ASYMMETRIC KEY CRYPTOSYSTEM WITH ONE-TO-MANY DISTRIBUTED KEY MANAGEMENT BASED ON PRIME MODULO DOUBLE ENCAPSULATION | 美國 | 16/448,445 | US 11,218,308 B2 | 2019-06-21 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2040-04-17 |
| 密钥产生方法及系统、加密及解密方法、加密通信系统 | 大陸 | 201811570509.4 | CN110958112B | 2018-12-18 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2038-12-18 |
| 素数モジュロの二重カプセル化に基づく1対多分配鍵管理によるポスト量子非対称鍵暗号化システム | 日本 | JP2019-123599 | 特許 7053537 | 2019-07-02 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2039-07-01 |
| POST-QUANTUM ASYMMETRIC KEY CRYPTOSYSTEM WITH ONE-TO-MANY DISTRIBUTED KEY MANAGEMENT BASED ON PRIME MODULO DOUBLE ENCAPSULATION | 韓國 | 10-2019-0102150 | 10-2354456 | 2019-08-21 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2039-08-21 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|--|----|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 氣體感測器封裝結構 | 台灣 | 106113166 | I 674653 | 2017-04-19 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2037-04-18 |
| HYBRID TFET-MOSFET CIRCUIT DESIGN | 美國 | 14/599,327 | US 9,412,439 B1 | 2015-01-16 | 2016-08-09 | 2015-01-16 | 2035-01-16 |
| 共振波長量測裝置及其量測方法 | 台灣 | 107103889 | I673481 | 2018-02-02 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2038-02-01 |
| RESONANT WAVELENGTH MEASUREMENT APPARATUS AND MEASUREMENT METHOD THEREOF | 美國 | 15/960,828 | US 10,775,237 B2 | 2018-04-24 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2038-04-23 |
| 頭戴式虛擬物件成像裝置 | 台灣 | 107100140 | I647485 | 2018-01-03 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2038-01-02 |
| HIGH-VOLTAGE GENERATOR WITH MULTI-STAGE SELECTION IN LOW-VOLTAGE TRANSISTOR PROCESS | 美國 | 15/912,585 | US 10,236,770 B1 | 2018-03-06 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2038-03-06 |
| Semiconductor device and manufacturing method thereof | 美國 | 16/383,594 | US 11,018,239 B2 | 2019-04-13 | 2021-05-25 | 2019-04-13 | 2039-04-13 |
| 微型發光二極體晶片的製作方法 | 台灣 | 108133864 | I740212 | 2019-09-19 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2039-09-18 |
| METHOD FOR MANUFACTURING MICRO LIGHT-EMITTING DIODE CHIPS | 美國 | 16/826,337 | US 10,944,024 B1 | 2020-03-23 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2040-03-22 |
| 卷積運算模組及方法以及其適用之卷積神經網路系統 | 台灣 | 109113187 | I768326 | 2020-04-20 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2040-04-19 |
| 深度神經網路壓縮的方法 | 台灣 | 109116293 | I737300 | 2020-05-15 | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2040-05-14 |
| Memory circuit and manufacturing method thereof | 美國 | 16/522,451 | US 11,631,447 B2 | 2019-07-25 | 2023-04-18 | 2019-07-25 | 2039-07-25 |
| 空間光調製器 | 台灣 | 109100382 | I727600 | 2020-01-07 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2040-01-06 |
| 空間光調製器 | 美國 | 17/079,556 | US 11,308,902 B2 | 2020-10-26 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2040-10-25 |
| 射頻積體電路及其製造方法 | 台灣 | 109118286 | I736300 | 2020-06-01 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2040-05-31 |
| RADIO FREQUENCY INTEGRATED CIRCUIT HAVING RELATIVELY SMALL CIRCUIT AREA AND METHOD OF FABRICATING THE SAME | 美國 | 16/940,093 | US 11,257,845 B2 | 2020-07-27 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2040-07-26 |
| 旋轉式碼盤及其設計方法 | 台灣 | 109114534 | I722886 | 2020-04-30 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2040-04-29 |
| ROTARY CODING DISC AND METHOD FOR DESIGNING THE SAME | 美國 | 16/943,071 | US 11,204,265 B2 | 2020-07-30 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2040-07-30 |
| 穿戴式生醫感測裝置 | 台灣 | 109128630 | I763010 | 2020-08-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2040-08-20 |
| 具有可撓式感測貼片的撓動脈訊號量測裝置 | 台灣 | 109119567 | I788673 | 2020-06-10 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2040-06-09 |
| RADIAL ARTERY SIGNAL MEASURING DEVICE | 美國 | 17/342,675 | US 12,004,847 B2 | 2021-06-09 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2042-03-24 |
| 以低密度奇偶校驗碼作為錯誤更正碼的資料解碼及其傳輸方法 | 台灣 | 109115069 | I712269 | 2020-05-06 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2040-05-05 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|--|----|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| DATA DECODING METHOD USING LDPC CODE AS ERROR CORRECTION CODE AND DATA TRANSMITTING METHOD THEREOF | 美國 | 16/992,359 | US 11,031,954 B1 | 2020-08-13 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2040-08-13 |
| 氣體感測裝置 | 台灣 | 109117765 | I767241 | 2020-05-28 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 2040-05-27 |
| 溝槽式電晶體及其製造方法 | 台灣 | 109117956 | I752512 | 2020-05-29 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2040-05-28 |
| SEMICONDUCTOR STRUCTURE OF TRENCH TRANSISTORS AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | 美國 | 17/011,506 | US 11,342,417 B2 | 2020-09-03 | 2022-05-24 | 2020-09-03 | 2040-09-28 |
| 製造具厚度變化的薄膜的方法 | 台灣 | 109126155 | I730862 | 2020-08-03 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2040-08-02 |
| METHOD OF FABRICATING THIN FILM WITH VARYING THICKNESS | 美國 | 17/094,754 | US 11,499,219 B2 | 2020-11-10 | 2022-11-15 | 2020-11-10 | 2040-11-09 |
| 具懸浮式加熱器之微型氣體感測器 | 台灣 | 109121815 | I764184 | 2020-06-29 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2040-06-28 |
| 電壓參考電路與低功率消耗感測器 | 台灣 | 109142145 | I741890 | 2020-12-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2040-11-30 |
| REFERENCE VOLTAGE GENERATING CIRCUIT AND LOW POWER CONSUMPTION SENSOR | 美國 | 17/324,601 | US 11,385,670 B2 | 2021-05-19 | 2022-07-12 | 2021-05-19 | 2041-05-18 |
| METHOD FOR SEARCHING A PATH BY USING A THREE-DIMENSIONAL RECONSTRUCTED MAP | 美國 | 17/825,503 | US 12,223,698 B2 | 2022-05-26 | 2025-02-11 | 2022-05-26 | 2043-04-18 |
| 雙偏振鎖模雷射系統及其增益模組及其控制方法 | 台灣 | 105132780 | I620383 | 2016-10-11 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2036-10-10 |
| 多波長雷射輸出系統與方法 | 台灣 | 102136642 | I519018 | 2013-10-09 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2033-10-08 |
| 雙波長雷射裝置及其製造方法 | 台灣 | 102120985 | I502834 | 2013-06-13 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2033-06-12 |
| 無線數據傳輸系統、傳送模組及接收模組 | 台灣 | 111102867 | I795189 | 2022-01-24 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2042-01-23 |
| 電漿放電電流分類系統及方法 | 台灣 | 111112699 | I833192 | 2022-03-31 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2042-03-30 |
| 互補式金氧半導體電容式壓力感測裝置及其製作方法 | 台灣 | 111108442 | I792938 | 2022-03-08 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 2042-03-07 |
| 多面體的光線感測裝置 | 台灣 | 111111754 | I804255 | 2022-03-28 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2042-03-27 |
| POLYHEDRON DEVICE FOR SENSING LIGHT RAYS | 美國 | 17/810,481 | US 11,777,442 B1 | 2022-07-01 | 2023-10-03 | 2022-07-01 | 2042-07-01 |
| 重建等效磁偶極子模型之方法及其電腦儲存介質與電腦程式產品 | 台灣 | 111106797 | I799156 | 2022-02-24 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2042-02-23 |
| 垂直型紫外光發光二極體基板的剝除方法 | 台灣 | 111114842 | I867293 | 2022-04-19 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2042-04-18 |
| 具有可調整焦距的光學系統 | 台灣 | 111100121 | I781034 | 2022-01-03 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2042-01-02 |
| 光學顯示系統 | 台灣 | 111105386 | I828063 | 2022-02-15 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2042-02-14 |
| VARIFOCAL LENS DEVICE, CORRECTIVE LENS ASSEMBLY, AND OPTICAL DISPLAY SYSTEM | 美國 | 17/739,796 | US 11,650,437 B1 | 2022-05-09 | 2023-05-16 | 2022-05-09 | 2042-05-09 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|---|----|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 液晶配向電極製作方法及其液晶盒製作方法 | 台灣 | 111111452 | I826980 | 2022-03-25 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2042-03-24 |
| 餅乾透鏡組件 | 大陸 | 202210301179.9 | CN116560084B | 2022-03-24 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2042-03-24 |
| 餅乾透鏡組件 | 台灣 | 111103681 | I805207 | 2022-01-27 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2042-01-26 |
| PANCAKES LENS ASSEMBLY | 美國 | 17/739,788 | US 11,809,027 B2 | 2022-05-09 | 2023-11-07 | 2022-05-09 | 2042-05-09 |
| 眼底鏡影像預測糖尿病性腎病變期程之方法及其系統 | 台灣 | 111100229 | I789199 | 2022-01-04 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2042-01-03 |
| 半導體裝置及其製造方法 | 台灣 | 111127804 | I819717 | 2022-07-25 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 2042-07-24 |
| 浮動保護環耐壓的穩定方法 | 台灣 | 111117125 | I795286 | 2022-05-06 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2042-05-05 |
| 寄生接面場效電晶體阻抗的降低方法 | 台灣 | 111117126 | I804303 | 2022-05-06 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2042-05-05 |
| METHOD FOR REDUCING PARASITIC JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR RESISTANCE | 美國 | 17/878,575 | US 12,463,039 B2 | 2022-08-01 | 2025-11-04 | 2022-08-01 | 2044-03-25 |
| SOURCE-BODY SELF-ALIGNED METHOD OF A VERTICAL DOUBLE DIFFUSED METAL OXIDE SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR | 美國 | 17/878,443 | US 12,256,559 B2 | 2022-08-01 | 2025-03-18 | 2022-08-01 | 2043-11-30 |
| 光學顯示系統 | 台灣 | 111117211 | I818537 | 2022-05-06 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2042-05-05 |
| Three dimensional integrated circuit and fabrication thereof | 美國 | 17/409,092 | US 11,784,119 B2 | 2021-08-23 | 2023-10-10 | 2021-08-23 | 2041-08-23 |
| Three dimensional integrated circuit and fabrication thereof | 美國 | 18/362,731 | US 12,211,789 B2 | 2023-07-31 | 2025-01-28 | 2021-08-23 | 2041-08-23 |
| 積體電路結構及其製造方法 | 台灣 | 111108054 | I807667 | 2022-03-04 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2042-03-03 |
| 穩壓式整流裝置 | 台灣 | 111146205 | I838996 | 2022-12-01 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2042-11-30 |
| 半導體裝置及其形成方法與積體電路結構 | 台灣 | 111125601 | I837724 | 2022-07-07 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2042-07-06 |
| VIDEO DISPLAY SYSTEMS, PORTABLE VIDEO DISPLAY APPARATUSES AND VIDEO ENHANCEMENT METHODS | 美國 | 17/820,118 | US 12,211,174 B2 | 2022-08-16 | 2025-01-28 | 2022-08-16 | 2042-08-16 |
| 影片播放系統、可攜式影片播放裝置及影片增強方法 | 台灣 | 111117044 | I822032 | 2022-05-05 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 2042-05-04 |
| 閘極驅動器、偵測一電晶體的一閾值電壓的裝置及其偵測方法 | 台灣 | 111150215 | I854416 | 2022-12-27 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2042-12-26 |
| 金屬鐵電金屬場效應電晶體、金屬鐵電金屬場效應電晶體陣列及其操作方法 | 台灣 | 111128451 | I825878 | 2022-07-28 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2042-07-27 |
| 手部動作分析方法及系統 | 台灣 | 113122532 | I875608 | 2024-06-18 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2044-06-17 |
| 用於埃技術節點的L型場效電晶體及相對應製造方法 | 台灣 | 112118718 | I866223 | 2023-05-19 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2043-05-18 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|---|----|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 高電子遷移率電晶體及其製備方法 | 台灣 | 112132022 | I838309 | 2023-08-25 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2043-08-24 |
| 高電子遷移率電晶體及其製備方法 | 韓國 | 10-2023-0181717 | 10-2846280 | 2023-12-14 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2043-12-14 |
| 高電子遷移率電晶體及其製備方法 | 日本 | JP2024-025334 | 特許 7755332 | 2024-02-22 | 2025-10-07 | 2024-02-22 | 2044-02-22 |
| 高頻高效率脈衝雷射發射器系統 | 台灣 | 112140835 | I871811 | 2023-10-25 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2043-10-24 |
| 多目標優化早期分類方法與電子裝置 | 台灣 | 112125905 | I863418 | 2023-07-11 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2043-07-10 |
| 雙向電壓轉換裝置 | 台灣 | 113104204 | I862411 | 2024-02-02 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2044-02-01 |
| P型氮化鎵半導體裝置及其製作方法 | 台灣 | 113113099 | I894905 | 2024-04-09 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2044-04-08 |
| 雙閘極高電子遷移率電晶體 | 台灣 | 112139038 | I870058 | 2023-10-12 | 2025-01-11 | 2025-01-11 | 2043-10-11 |
| 增加功率電晶體底部閘極氧化層厚度的製程方法及其形成之溝槽式閘極結構 | 台灣 | 112147637 | I856895 | 2023-12-07 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 2043-12-06 |
| 功率元件之動態導通電阻與臨界電壓不穩定性之量測電路及其操作方法 | 台灣 | 113117390 | I883950 | 2024-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2044-05-09 |
| 單晶半導體結構光投影儀 | 台灣 | 113133150 | I904834 | 2024-09-02 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2044-09-01 |
| 光收發系統 | 台灣 | 113110414 | I908005 | 2024-03-20 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2044-03-19 |
| 高速傳輸接收機及數位訊號處理單元 | 台灣 | 113129991 | I915915 | 2024-08-09 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 2044-08-08 |
| HIGH SPEED TRANSCEIVER AND DIGITAL SIGNAL PROCESSING UNIT | 美國 | 19/085,627 | US 2026/0046175 A1 | 2025-03-20 | | | |
| X光感測面板、X光感測元件及其使用方法和包括其的半導體結構形成方法 | 台灣 | 113110900 | I899909 | 2024-03-22 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2044-03-21 |
| 顯示器之單位畫素的生成方法 | 台灣 | 113128264 | I880829 | 2024-07-30 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2044-07-29 |
| 導電橋式記憶體元件及其製備方法 | 台灣 | 113125679 | I909540 | 2024-07-09 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 2044-07-08 |
| 資料壓縮方法及其對應之資料解壓縮裝置 | 台灣 | 113133185 | I911887 | 2024-09-03 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 2044-09-02 |
| 多相位雙邊緣數位脈衝寬度調變裝置 | 台灣 | 113137363 | I904879 | 2024-09-30 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2044-09-29 |
| 可編程調整像素解析度的電容感測陣列晶片及其取樣裝置與其控制系統 | 美國 | 18/668,308 | US 12,519,473 B2 | 2024-05-20 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2044-05-20 |
| 可編程調整像素解析度的電容感測陣列晶片及其取樣裝置與其控制系統 | 日本 | JP2024-081458 | 特許 7761295 | 2024-05-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2044-05-20 |
| 可編程調整像素解析度的電容感測陣列晶片及其取樣裝置與其控制系統 | 台灣 | 113118659 | I885910 | 2024-05-20 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2044-05-19 |
| 記憶體內運算(CIM)裝置及其縮放係數的訓練方法 | 台灣 | 113135131 | I884084 | 2024-09-16 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2044-09-15 |
| 穿戴式神經刺激與感測裝置 | 台灣 | 113145056 | I881933 | 2024-11-22 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2044-11-21 |
| 記憶體內運算裝置、系統及其操作方法 | 台灣 | 113146410 | I913031 | 2024-11-29 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2044-11-28 |
| 高電子遷移率氮化鎵電晶體 | 台灣 | 113141437 | I910886 | 2024-10-30 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2044-10-29 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|---|----|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 適用於反平方根運算和倒數運算之間切換的電路架構 | 台灣 | 113146990 | I882937 | 2024-12-04 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2044-12-03 |
| 三元內容可定址記憶體之漏電流超截斷裝置 | 台灣 | 96149999 | I349288 | 2007-12-25 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 2027-12-24 |
| 用於全像儲存裝置的灰階碼之編碼與解碼方法 | 台灣 | 96149176 | I350534 | 2007-12-21 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 2027-12-20 |
| 絕對延遲時間產生裝置 | 台灣 | 097127581 | I364165 | 2008-07-21 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 2028-07-20 |
| 絕對延遲時間產生裝置 | 日本 | JP2008-266708 | 特許 5250380 | 2008-10-15 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 2028-10-15 |
| 用於全數位鎖相迴路設計之數位濾波器 | 台灣 | 097138825 | I360950 | 2008-10-09 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2028-10-08 |
| 波長多工兼具位移多工之全像式儲存裝置 | 台灣 | 097136465 | I384474 | 2008-09-23 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2028-09-22 |
| 數位式自我校正鎖相迴路 | 台灣 | 097142033 | I381647 | 2008-10-31 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2028-10-30 |
| 氮化鎵電晶體的製作方法 | 大陸 | 201010593719.2 | CN102569071B | 2010-12-15 | 2014-12-24 | 2014-12-24 | 2030-12-15 |
| 靜態隨機存取記憶體胞元及其操作方法 | 台灣 | 100107824 | I463493 | 2011-03-08 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2031-03-07 |
| 使用共用傳導層傳送晶片間多重信號之系統 | 台灣 | 99135525 | I430426 | 2010-10-19 | 2014-03-11 | 2014-03-11 | 2030-10-18 |
| 光學讀寫頭 | 台灣 | 100105919 | I413118 | 2011-02-23 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2031-02-22 |
| OPTICAL PICKUP HEAD(發明人自費) | 美國 | 13/360,182 | US 8,477,573 B2 | 2012-01-27 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 2032-01-27 |
| 利用下壓方式組裝之三維斜面微結構 | 台灣 | 100105920 | I488801 | 2011-02-23 | 2015-06-21 | 2015-06-21 | 2031-02-22 |
| WIRELESS INTRAOCULAR PRESSURE MONITORING DEVICE, AND DETECTING MODULE THEREOF | 美國 | 13/845,843 | US 8,939,906 B2 | 2013-03-18 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2033-03-18 |
| 製造有機電子元件的裝置及其方法 | 台灣 | 101128684 | I496330 | 2012-08-08 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2032-08-07 |
| 靜態隨機存取記憶體 | 台灣 | 101133687 | I484499 | 2012-09-14 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2032-09-13 |
| CONTROL CIRCUIT OF SRAM AND OPERATING METHOD THEREOF | 美國 | 13/738,111 | US 9,159,403 B2 | 2013-01-10 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2033-05-10 |
| 靜態隨機存取記憶體的電路及其操作方法 | 台灣 | 101132567 | I475565 | 2012-09-06 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2032-09-05 |
| 使用擬隨機碼控制功率電晶體導通及關閉時序隨機延遲的裝置 | 台灣 | 101125481 | I492537 | 2012-07-16 | 2015-07-11 | 2015-07-11 | 2032-07-15 |
| 二次光學元件及光源模組 | 台灣 | 103119027 | I579487 | 2014-05-30 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2034-05-29 |
| SECONDARY OPTICAL ELEMENT AND LIGHT SOURCE MODULE | 美國 | 14/469,590 | US 9,388,957 B2 | 2014-08-27 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2034-11-01 |
| 二次光学元件及光源模块 | 大陸 | 201410338627.8 | CN105222086B | 2014-07-16 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2034-07-16 |
| 高電子遷移率電晶體及其製造方法 | 台灣 | 103138491 | I549297 | 2014-11-06 | 2016-09-11 | 2016-09-11 | 2034-11-05 |
| 磁力計 | 台灣 | 104102814 | I529404 | 2015-01-28 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2035-01-27 |
| 具有大晶粒之銅薄膜、包含其之銅箔基板、以及該銅箔基板之製備方法 | 台灣 | 103143343 | I545231 | 2014-12-11 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2034-12-10 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|--|----|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| COPPER FILM WITH LARGE GRAINS, COPPER CLAD LAMINATE HAVING THE SAME AND MANUFACTURING METHOD OF COPPER CLAD LAMINATE | 美國 | 14/948,708 | US 9,994,967 B2 | 2015-11-23 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2036-02-24 |
| PROGRAMMABLE QUICK DISCHARGE CIRCUIT AND METHOD THEREOF | 美國 | 14/616,201 | US 9,857,811 B2 | 2015-02-06 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2035-12-12 |
| 薄型平面生醫感測器 | 台灣 | 104107171 | I574666 | 2015-03-06 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2035-03-05 |
| ELECTRICALLY FOCUS-TUNABLE LENS AND EYEWEAR INCLUDING THE SAME | 美國 | 16/004,506 | US 10,613,350 B2 | 2018-06-11 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2038-11-15 |
| 有源矩陣式調焦鏡片及具有該鏡片的調焦眼鏡 | 大陸 | 201810709522.7 | CN109669277B | 2018-07-02 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2038-07-01 |
| 具寬能隙氧化物之深紫外線感測裝置 | 台灣 | 106131302 | I643320 | 2017-09-12 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 2037-09-11 |
| 偏振無關液晶相位調製器 | 大陸 | 201810947897.7 | CN109696777B | 2018-08-20 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2038-08-19 |
| 偏振無關液晶相位調製器 | 台灣 | 106136183 | I647513 | 2017-10-20 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2037-10-19 |
| POLARIZATION INDEPENDENT OPTICAL PHASE MODULATOR | 美國 | 16/001,138 | US 10,824,020 B2 | 2018-06-06 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2038-10-11 |
| CHARGE PUMP CIRCUIT AND PHASE LOCKED LOOP SYSTEM USING THE SAME | 美國 | 16/116,078 | US 10,277,122 B1 | 2018-08-29 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2038-08-29 |
| 半導體裝置的製造方法與半導體裝置 | 大陸 | 201710768125.2 | CN108122993B | 2017-08-31 | 2022-10-18 | 2017-08-31 | 2037-08-31 |
| Impact ionization semiconductor device and manufacturing method thereof | 美國 | 15/649,331 | US 10,510,903 B2 | 2017-07-13 | 2019-12-17 | 2017-07-13 | 2037-08-31 |
| 半導體裝置的製造方法與半導體裝置 | 台灣 | 106129203 | I733891 | 2017-08-28 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2037-08-27 |
| Impact ionization semiconductor device and manufacturing method thereof | 美國 | 16/687,751 | US 10,868,195 B2 | 2019-11-19 | 2020-12-15 | 2017-07-13 | 2037-07-13 |
| Impact ionization semiconductor device and manufacturing method thereof | 美國 | 16/716,318 | US 11,031,510 B2 | 2019-12-16 | 2021-06-08 | 2017-07-13 | 2021-06-08 |
| 光學編碼裝置 | 台灣 | 107139014 | I659196 | 2018-11-02 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 2038-11-01 |
| OPTICAL ENCODING DEVICE FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING | 美國 | 16/539,002 | US 11,009,373 B2 | 2019-08-13 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2039-12-04 |
| 有機多元發光層以及使用此有機多元發光層有機發光元件 | 台灣 | 108118081 | I808182 | 2019-05-24 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2039-05-23 |
| 光脈衝量測裝置以及光脈衝量測方法 | 台灣 | 107118023 | I672484 | 2018-05-25 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2038-05-24 |
| MEASURING DEVICE AND MEASURING METHOD | 美國 | 16/165,625 | US 11,169,031 B2 | 2018-10-19 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2040-02-10 |
| 光脈衝測量裝置以及測量方法 | 大陸 | 201810669907.5 | CN110530532B | 2018-06-26 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2038-06-26 |
| 光脈衝量測裝置以及光脈衝量測方法 | 日本 | JP2018-196818 | 特許 7210002 | 2018-10-18 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2038-10-18 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|---|----|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 無非線性晶體之自相關儀 | 美國 | 17/484,563 | US 11,733,103 B2 | 2021-09-24 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2041-09-23 |
| MEASURING DEVICE AND MEASURING METHOD | 美國 | 18/133,250 | US 12,392,667 B2 | 2023-04-11 | 2025-08-19 | 2023-04-11 | 2038-10-19 |
| WIRELESS POWER SYSTEM | 美國 | 16/240,789 | US 11,025,081 B2 | 2019-01-06 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2039-07-31 |
| 無線電力系統 | 台灣 | 107116670 | I692166 | 2018-05-16 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2038-05-15 |
| BIOMEDICAL STIMULATION PROTECTION DEVICE | 美國 | 16/367,670 | US 10,439,385 B1 | 2019-03-28 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2039-03-28 |
| 生醫刺激保護裝置 | 台灣 | 107135480 | I667993 | 2018-10-09 | 2019-08-11 | 2019-08-11 | 2038-10-08 |
| 有機發光裝置及其製造方法 | 台灣 | 107115103 | I740036 | 2018-05-03 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2038-05-02 |
| 非揮發性記憶體及其操作方法 | 台灣 | 107112431 | I686930 | 2018-04-11 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2038-04-10 |
| NONVOLATILE MEMORY COMPRISING VARIABLE RESISTANCE TRANSISTORS AND METHOD FOR OPERATING THE SAME | 美國 | 15/950,193 | US 10,756,267 B2 | 2018-04-11 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2038-04-11 |
| 非挥发性记忆体及其操作方法 | 大陸 | 201810320176.3 | CN108694983B | 2018-04-11 | 2021-03-30 | 2018-04-11 | 2038-04-11 |
| 有機發光元件 | 台灣 | 107117120 | I713848 | 2018-05-18 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2038-05-17 |
| ORGANIC LIGHT-EMITTING DEVICE | 美國 | 16/260,720 | US 11,522,151 B2 | 2019-01-29 | 2022-12-06 | 2019-01-29 | 2040-08-26 |
| 有机发光组件 | 大陸 | 201810612827.6 | CN108922986B | 2018-06-14 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2038-06-13 |
| 一種穿透式電子顯微鏡試片及其製造方法 | 台灣 | 107125009 | I670481 | 2018-07-19 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2038-07-18 |
| TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE SPECIMEN AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME | 美國 | 16/431,715 | US 10,804,071 B2 | 2019-06-04 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2039-06-24 |
| 無線收發裝置 | 台灣 | 107103738 | I669912 | 2018-02-02 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2038-02-01 |
| WIRELESS TRANSCEIVER | 美國 | 16/183,849 | US 10,454,436 B2 | 2018-11-08 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2038-11-07 |
| NEGATIVE HIGH-VOLTAGE GENERATION DEVICE WITH MULTI-STAGE SELECTION | 美國 | 16/025,205 | US 10,312,791 B1 | 2018-07-02 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2038-07-02 |
| 光學位移感測系統 | 台灣 | 107135911 | I683085 | 2018-10-12 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2038-10-11 |
| OPTICAL DISPLACEMENT SENSING SYSTEM | 美國 | 16/600,158 | US 11,015,918 B2 | 2019-10-11 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2039-10-11 |
| OPTICAL DISPLACEMENT SENSING SYSTEM | 美國 | 17/240,491 | US 11,480,426 B2 | 2021-04-26 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2039-10-11 |
| 快充驅動器 | 台灣 | 110119740 | I762338 | 2021-05-31 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2041-05-30 |
| FAST CHARGING DRIVER | 美國 | 17/660,835 | US 12,155,256 B2 | 2022-04-27 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2043-07-19 |
| 光達與用於光達之光子數快速累積方法 | 台灣 | 109141010 | I735384 | 2020-11-23 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2040-11-22 |
| LIDAR AND METHOD OF FAST PHOTON-COUNT INTEGRATION FOR LIDAR | 美國 | 17/529,783 | US 12,360,220 B2 | 2021-11-18 | 2025-07-15 | 2021-11-18 | 2044-05-16 |
| 增加溝槽式閘極功率金氧半場效電晶體之溝槽轉角氧化層厚度的製造方法 | 台灣 | 109138841 | I739653 | 2020-11-06 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2040-11-05 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|---|----|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| METHOD FOR INCREASING AN OXIDE THICKNESS AT TRENCH CORNER OF AN U-SHAPED GATE METAL-OXIDE-SEMICONDUCTOR FIELD-EFFECT TRANSISTOR | 美國 | 17/161,951 | US 11,538,920 B2 | 2021-01-29 | 2022-12-27 | 2021-01-29 | 2041-08-01 |
| U字型ゲートMOSFETのトレンチコーナー部酸化物層の厚さを増加させる製造方法 | 日本 | JP2021-004192 | 特許 7141758 | 2021-01-14 | 2022-09-14 | 2021-01-14 | 2041-01-14 |
| 加密式光學系統 | 台灣 | 111133749 | I810057 | 2022-09-06 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2042-09-05 |
| 摻雜金屬元素的奈米雙晶銅金屬層、包含其之基板及其製備方法 | 台灣 | 110107953 | I746383 | 2021-03-05 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2041-03-04 |
| NANO-TWINNED COPPER LAYER WITH DOPED METAL ELEMENT, SUBSTRATE COMPRISING THE SAME AND METHOD FOR PREPARING THE SAME | 美國 | 17/321,717 | US 11,560,639 B2 | 2021-05-17 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2041-05-17 |
| Optimization for High Repetition Rate Pulse Raman Laser | 美國 | 17/201,476 | US 11,522,333 B2 | 2021-03-15 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2041-02-17 |
| 高脈衝重複率拉曼雷射之優化條件 | 台灣 | 109135385 | I721933 | 2020-10-13 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2040-10-12 |
| 陣列式晶片的切割方法 | 台灣 | 110104045 | I771893 | 2021-02-03 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2041-02-02 |
| Three dimensional integrated circuit and fabrication thereof | 美國 | 16/727,395 | US 11,476,248 B2 | 2019-12-26 | 2022-10-18 | 2019-12-26 | 2039-12-26 |
| Three dimensional integrated circuit and fabrication thereof | 美國 | 17/874,176 | US 12,057,447 B2 | 2022-07-26 | 2024-08-06 | 2019-12-26 | 2040-07-03 |
| 電子裝置之電路的修補方法 | 台灣 | 110101028 | I760059 | 2021-01-12 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2041-01-11 |
| 石英振盪器的製作方法與結構 | 台灣 | 110104072 | I763298 | 2021-02-03 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2041-02-02 |
| 最小功率輸入的控制方法 | 台灣 | 110107895 | I741958 | 2021-03-05 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2041-03-04 |
| CONTROL METHOD OF A MINIMUM POWER INPUT | 美國 | 17/334,058 | US 11,569,696 B2 | 2021-05-28 | 2023-01-31 | 2021-05-28 | 2041-08-06 |
| 導電橋式記憶體元件的製作方法 | 台灣 | 110109341 | I764624 | 2021-03-16 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2041-03-15 |
| METHOD FOR MANUFACTURING A CONDUCTIVE BRIDGING MEMORY DEVICE | 美國 | 17/464,601 | US 12,290,010 B2 | 2021-09-01 | 2025-04-29 | 2021-09-01 | 2041-09-01 |
| 多位元唯讀記憶體的操作方法 | 台灣 | 110115229 | I747784 | 2021-04-28 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2041-04-27 |
| 多位元唯讀記憶體的操作方法 | 台灣 | 110115227 | I747783 | 2021-04-28 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2041-04-27 |
| 可配置的量子電子元件 | 台灣 | 110118412 | I765717 | 2021-05-21 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 2041-05-20 |
| 利用最小化腔內斯托克斯波之損耗實現高效率拉曼可見光雷射 | 台灣 | 110108779 | I810534 | 2021-03-11 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2041-03-10 |
| 壓控變頻脈衝寬度調制電路 | 台灣 | 110129312 | I802952 | 2021-08-09 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2041-08-08 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|--|----|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Voltage-Controlled Varied Frequency Pulse Width Modulator | 美國 | 17/452,842 | US 11,387,824 B1 | 2021-10-29 | 2022-07-12 | 2021-10-29 | 2041-10-29 |
| 具有液晶元件的餅乾透鏡組件 | 台灣 | 110124063 | I807358 | 2021-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2041-06-29 |
| OPTICAL SYSTEM INCLUDING PANCAKE LENS ASSEMBLY | 美國 | 17/668,141 | US 12,326,573 B2 | 2022-02-09 | 2025-06-10 | 2022-02-09 | 2042-02-09 |
| 利用提升腔內反射率實現高效率之拉曼可見光雷射 | 台灣 | 110127969 | I810621 | 2021-07-29 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2041-07-28 |
| 覆晶式微發光二極體晶粒的製法及其製品 | 台灣 | 110128409 | I807377 | 2021-08-02 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2041-08-01 |
| 接合元件及其製備方法 | 台灣 | 110127041 | I769022 | 2021-07-22 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2041-07-21 |
| BONDING ELEMENT AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME | 美國 | 17/477,996 | US 11,621,241 B2 | 2021-09-17 | 2023-04-04 | 2021-09-17 | 2041-12-08 |
| 功率半導體裝置的散熱方法 | 台灣 | 110140786 | I776721 | 2021-11-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2041-11-01 |
| 偏振扭轉雙脈衝光產生裝置 | 台灣 | 110127481 | I776611 | 2021-07-27 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2041-07-26 |
| MFMFET, MFMFET ARRAY, AND THE OPERATING METHOD THEREOF | 美國 | 17/982,156 | US 12,260,891 B2 | 2022-11-07 | 2025-03-25 | 2022-11-07 | 2042-11-07 |
| 用於記憶體內運算(CIM)的記憶體陣列及其操作方法 | 台灣 | 111142460 | I849566 | 2022-11-07 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 2042-11-06 |
| 封装结构 | 大陸 | 202321602114.4 | CN220585228U | 2023-06-21 | 2024-03-12 | 2023-06-21 | 2033-06-21 |
| 立體式源極接觸結構 | 台灣 | 111134907 | I885289 | 2022-09-15 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2042-09-14 |
| 立體式源極接觸結構 | 台灣 | 111134908 | I885290 | 2022-09-15 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2042-09-14 |
| 立體式源極接觸結構之製程方法 | 台灣 | 111134909 | I830380 | 2022-09-15 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 2042-09-14 |
| 顯示系統 | 大陸 | 202221440223.6 | CN218112512U | 2022-06-09 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2032-06-09 |
| 溝槽式閘極功率金氧半場效電晶體之閘極製程方法及其形成之溝槽式閘極結構 | 台灣 | 111136331 | I810076 | 2022-09-26 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2042-09-25 |
| GATE FABRICATION METHOD OF AN U-METAL-OXIDE-SEMICONDUCTOR FIELD-EFFECT TRANSISTOR AND TRENCH GATE STRUCTURE FORMED THEREOF | 美國 | 18/107,397 | US 12,507,436 B2 | 2023-02-08 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2043-02-08 |
| 自動化輔助步態訓練裝置與方法 | 美國 | 16/420,617 | US 11,744,762 B2 | 2019-05-23 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2042-05-18 |
| 步態學習輔助系統及其應用方法 | 台灣 | 107126172 | I684442 | 2018-07-27 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2038-07-26 |
| Two-piece optical prism | 美國 | 16/152,430 | US 11,353,637 B2 | 2018-10-05 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2040-09-14 |
| 金氧半閘堆疊結構的製造方法 | 台灣 | 103123414 | I531071 | 2014-07-08 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2034-07-07 |
| METHOD FOR MANUFACTURING GATE STACK STRUCTURE IN INSTA-METAL-OXIDE-SEMICONDUCTOR FIELD-EFFECT-TRANSISTOR | 美國 | 14/619,594 | US 9,299,796 B2 | 2015-02-11 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2035-02-11 |
| 一種多工器架構之運作方法 | 台灣 | 095126150 | I326997 | 2006-07-17 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | 2026-07-16 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|---|----|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 利用數位激發訊號來準確測量放大器開路增益之裝置 | 台灣 | 096150435 | I361900 | 2007-12-27 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 2027-12-26 |
| 利用數字激發信號來準確測量放大器開路增益的裝置 | 大陸 | 200810002352.5 | CN101487863B | 2008-01-15 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2028-01-15 |
| 發光二極體裝置及其製造方法 | 台灣 | 095135065 | I311381 | 2006-09-22 | 2009-06-21 | 2009-06-21 | 2026-06-21 |
| 管線化架構可重組混合基底的快速傅利葉轉換處理器 | 台灣 | 095148299 | I323850 | 2006-12-21 | 2010-04-21 | 2010-04-21 | 2026-12-20 |
| 混合電壓輸入 / 輸出緩衝器 | 台灣 | 095149776 | I328348 | 2006-12-29 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | 2026-12-28 |
| 畫素驅動電路及其驅動方法與應用 | 台灣 | 96112606 | I357059 | 2007-04-10 | 2012-01-21 | 2012-01-21 | 2027-04-09 |
| 利用電荷轉移之液晶顯示畫素驅動方式 | 日本 | JP2007-138483 | 特許 4870026 | 2007-05-25 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 2027-05-25 |
| 利用電荷轉移之液晶顯示畫素驅動方式 | 韓國 | 10-2007-0074522 | 10-0886061 | 2007-07-25 | 2009-02-20 | 2009-02-20 | 2027-07-25 |
| 蝴蝶式比較線結構及其搜尋方法 | 台灣 | 096102126 | I324346 | 2007-01-19 | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 2027-01-18 |
| 同軸全息照相儲存裝置及其方法 | 大陸 | 201010161159.3 | 1734752 | 2010-04-07 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2030-04-07 |
| 同軸全息照相儲存裝置及其方法 | 大陸 | 201010161293.3 | CN102214469B | 2010-04-08 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2030-04-08 |
| 讀取裝置 | 大陸 | 201010161295.2 | CN102214470B | 2010-04-08 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2030-04-08 |
| 讀取裝置 | 台灣 | 099110930 | I412785 | 2010-04-08 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2030-04-07 |
| 同軸全像儲存媒體 | 台灣 | 099110932 | I420519 | 2010-04-08 | 2013-12-21 | 2013-12-21 | 2030-04-07 |
| 同軸全像儲存裝置及其方法 | 台灣 | 099109431 | I412031 | 2010-03-29 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2030-03-28 |
| 讀取裝置 | 日本 | JP2010-203624 | 特許 5344257 | 2010-09-10 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 2030-09-10 |
| 同軸全像儲存媒體 | 日本 | JP2010-182539 | 特許 5113225 | 2010-08-17 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 2030-08-17 |
| 同軸全像儲存裝置及其方法 | 日本 | JP2010-157523 | 特許 5435291 | 2010-07-12 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2030-07-12 |
| 讀取裝置 | 韓國 | 10-2010-0113803 | 10-1270677 | 2010-11-16 | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 2030-11-16 |
| Collinear Holographic Storage Medium | 韓國 | 10-2010-0127918 | 10-1260810 | 2010-12-14 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2030-12-14 |
| 同軸全像儲存裝置及其方法 | 韓國 | 10-2010-0113804 | 10-1216972 | 2010-11-16 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2030-11-16 |
| 次臨界多埠暫存器 | 台灣 | 099103450 | I453749 | 2010-02-05 | 2014-09-21 | 2014-09-21 | 2030-02-04 |
| 以六電晶體為基礎架構之靜態隨機記憶體陣列 | 台灣 | 101106197 | I517155 | 2012-02-24 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 2032-02-23 |
| 用以量測偏壓溫度效應之環形震盪器 | 台灣 | 101106198 | I483251 | 2012-02-24 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2032-02-23 |
| 基於使用者回饋資訊之電器偵測方法與系統 | 歐盟 | EP12173049.3 | EP2595098B1 | 2012-06-21 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2032-06-21 |
| 用於全像儲存之影像定位方法 | 台灣 | 100135557 | I444993 | 2011-09-30 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2031-09-29 |
| ホログラフィックデータストレージに用いる画像位置決め方法 | 日本 | JP2011-273508 | 特許 5744711 | 2011-12-14 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2031-12-14 |
| 全像儲存系統及其影像識別方法 | 台灣 | 100135044 | I457921 | 2011-09-28 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2031-09-27 |
| Electrostatic discharge protection circuit | 美國 | 12/705339 | US 8,507,946 B4 | 2010-02-12 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 2030-02-12 |
| METHOD FOR FABRICATING THIN-FILM TRANSISTOR | 美國 | 14/075,039 | US 8,932,916 B2 | 2013-11-08 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2033-11-08 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|---|----|-------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 用於金屬有機化學氣相沉積的真空壓力控制裝置 | 台灣 | 102128825 | I554638 | 2013-08-12 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2033-08-11 |
| 發光二極體元件 | 台灣 | 103112244 | I550902 | 2014-04-02 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 2034-04-01 |
| Light Emitting Diode Device Having Super Lattice Structure and a Nano-Structure Layer | 美國 | 14/461,990 | US 9,240,518 B2 | 2014-08-18 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2034-08-18 |
| 高品質高可靠度奈米級側向成長磊晶層之薄膜發光二極體著作方法 | 大陸 | 201410394673.X | CN104979448B | 2014-08-12 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2034-08-12 |
| 非侵入式眼壓感測元件 | 台灣 | 102134839 | I523637 | 2013-09-26 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2033-09-25 |
| 非侵入式眼压传感元件 | 大陸 | 201310716790.9 | CN104510443B | 2013-12-23 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2033-12-23 |
| 半導體氣體感測裝置的製作方法及其半導體氣體感測裝置 | 台灣 | 105124541 | I601686 | 2016-08-03 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2036-08-02 |
| CMOS-BASED PROCESS FOR MANUFACTURING A SEMICONDUCTOR GAS SENSOR | 美國 | 15/398,025 | US 9,746,437 B1 | 2017-01-04 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2037-01-04 |
| 半导体气体感测装置的制作方法及其半导体气体感测装置 | 大陸 | 201710156809.7 | CN107686093B | 2017-03-16 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2037-03-15 |
| 具備視力矯正功能之頭戴式顯示裝置 | 台灣 | 105112739 | I641868 | 2016-04-23 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2036-04-22 |
| HEAD-MOUNTED DISPLAY APPARATUS | 美國 | 15/493,548 | US 10,222,621 B2 | 2017-04-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2037-04-20 |
| 半導體裝置及其製造方法 | 台灣 | 105141643 | I604605 | 2016-12-15 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2036-12-14 |
| 半导体装置及其制造方法 | 大陸 | 201710048777.9 | CN108231863B | 2017-01-20 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2037-01-20 |
| 半導體裝置及其製造方法 | 日本 | JP2017-053220 | 特許 6305596 | 2017-03-17 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2037-03-17 |
| 半導體裝置及其製造方法 | 德國 | 10 2017 119 774.5 | DE102017119774B4 | 2017-08-29 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2037-08-29 |
| 半導體裝置及其製造方法 | 韓國 | 10-2017-0118416 | 10-1955195 | 2017-09-15 | 2019-02-28 | 2017-09-15 | 2037-09-15 |
| 微加熱裝置 | 台灣 | 106116654 | I663890 | 2017-05-19 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2037-05-18 |
| 集積型多元感測器模組 | 台灣 | 105113183 | I625527 | 2016-04-27 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2036-04-26 |
| 太陽能裂解水產氫裝置 | 台灣 | 108119080 | I680099 | 2019-05-31 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2039-05-30 |
| 電場產生基板及包含其的液晶透鏡 | 台灣 | 108115640 | I741290 | 2019-05-07 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2039-05-06 |
| ELECTRIC FIELD GENERATING SUBSTRATE AND LIQUID CRYSTAL LENS COMPRISING THE SAME | 美國 | 16/654,118 | US 11,048,141 B2 | 2019-10-16 | 2021-06-29 | 2019-10-16 | 2039-10-16 |
| 測距裝置及方法 | 台灣 | 108116024 | I704367 | 2019-05-09 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2039-05-08 |
| 雜訊抑制技術於單光子測距儀之應用 | 美國 | 16/705,575 | US 11,536,811 B2 | 2019-12-06 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2039-12-06 |
| 氮化鎵異質整合於矽基板之半導體結構及其製造方法 | 台灣 | 108117447 | I728364 | 2019-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2039-05-20 |
| シリコン基板に窒化ガリウムをヘテロ統合した半導体構造、及びその製造方法 | 日本 | JP2019-123178 | 特許 6804778 | 2019-07-01 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2039-07-01 |
| Device and method for operating the same | 美國 | 16/162,582 | US 11,494,619 B2 | 2018-10-17 | 2022-11-08 | 2018-10-17 | 2041-06-10 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|--|----|-----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| METHOD OF FABRICATING TRANSISTOR WITH SHORT GATE LENGTH BY TWO-STEP PHOTOLITHOGRAPHY | 美國 | 16/865,286 | US 11,367,615 B2 | 2020-05-01 | 2022-06-21 | 2020-05-01 | 2040-08-03 |
| METHOD OF FABRICATING TRANSISTOR WITH SHORT GATE LENGTH BY TWO-STEP PHOTOLITHOGRAPHY | 韓國 | 10-2020-0099487 | 10-2429831 | 2020-08-07 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2040-08-07 |
| 利用二段式曝光製造小線寬高電子遷移率電晶體之方法 | 台灣 | 108142207 | I717114 | 2019-11-20 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2039-11-19 |
| 具有寬能隙三五族汲極之金屬氧化物矽半導體場效電晶體及其製造方法 | 台灣 | 108142879 | I715311 | 2019-11-26 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2039-11-25 |
| SILICON METAL-OXIDE-SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR (Si MOSFET) WITH A WIDE-BANDGAP III-V COMPOUND SEMICONDUCTOR GROUP DRAIN AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME | 美國 | 17/007,967 | US 11,271,109 B2 | 2020-08-31 | 2022-03-08 | 2020-08-31 | 2040-08-31 |
| 具有寬能隙三五族汲極的金屬氧化物矽半導體場效晶體管及其製造方法 | 大陸 | 201911236326.3 | CN111029400B | 2019-12-05 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2039-12-04 |
| ワイドギャップ III - V 族化合物半導体ドレインを有する Si - MOSFET、及びその製造方法 | 日本 | JP2020-188266 | 特許 7019218 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | 2020-11-11 | 2040-11-11 |
| 具有寬能隙三五族汲極之金屬氧化物矽半導體場效電晶體及其製造方法 | 韓國 | 10-2020-0146851 | 10-2521609 | 2020-11-05 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2040-11-05 |
| 液晶透鏡 | 台灣 | 108130640 | I709790 | 2019-08-27 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2039-08-26 |
| LIQUID CRYSTAL LENS | 美國 | 16/666,525 | US 10,802,374 B1 | 2019-10-29 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2039-10-28 |
| 正結構有機太陽能電池 | 台灣 | 108142745 | I726499 | 2019-11-25 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2039-11-24 |
| 製造III-V族半導體裝置的互連件之方法·及III-V族半導體裝置 | 台灣 | 108132587 | I717829 | 2019-09-10 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2039-09-09 |
| PROCESS FOR MAKING INTERCONNECT OF GROUP III-V SEMICONDUCTOR DEVICE, AND GROUP III-V SEMICONDUCTOR DEVICE INCLUDING INTERCONNECT MADE THEREBY | 美國 | 16/702,282 | US 11,322,398 B2 | 2019-12-03 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2040-10-25 |
| 制造III-V族半导体装置互连件的方法及III-V族半导体装置 | 大陸 | 201911045385.2 | CN112563191B | 2019-10-30 | 2024-05-28 | 2019-10-30 | 2039-10-30 |
| III - V 族半導体デバイスの相互接続を作成する方法、及びそれによって作成された相互接続を含む III - V 族半導体デバイス | 日本 | JP2019-222944 | 特許 6949384 | 2019-12-10 | 2021-09-27 | 2021-10-13 | 2039-12-10 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|---|----|-----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| PROCESS FOR MAKING INTERCONNECT OF GROUP III-V SEMICONDUCTOR DEVICE, AND GROUP III-V SEMICONDUCTOR DEVICE INCLUDING INTERCONNECT MADE THEREBY | 韓國 | 10-2020-0011403 | 10-2242416 | 2020-01-30 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2040-01-30 |
| 畫素電路以及驅動方法 | 台灣 | 108115471 | I715025 | 2019-05-03 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2039-05-02 |
| 具有可撻式感測貼片的穿戴裝置 | 台灣 | 108148463 | I795620 | 2019-12-30 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 2039-12-29 |
| Self-aligned unsymmetrical gate (SAUG) FinFET and methods of forming the same | 美國 | 16/374,475 | US 10,971,629 B2 | 2019-04-03 | 2021-04-06 | 2019-04-03 | 2039-04-03 |
| 可撻式氧化物單晶及其製造方法 | 台灣 | 109100792 | I717968 | 2020-01-09 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2040-01-08 |
| 人員室內定位與移動機器人對特定人員追蹤互動之系統及其方法 | 台灣 | 109108085 | I739339 | 2020-03-11 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2040-03-10 |
| 閘極驅動裝置 | 台灣 | 108121901 | I703543 | 2019-06-24 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2039-06-23 |
| 閘極驅動裝置 | 台灣 | 108208039 | M585417 | 2019-06-24 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2029-06-23 |
| 彎曲感測電子裝置 | 台灣 | 108145390 | I712777 | 2019-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2039-12-10 |
| 低功耗且低反沖雜訊的比較電路 | 台灣 | 108144553 | I701908 | 2019-12-05 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2039-12-04 |
| 低電源雜訊的比較電路 | 台灣 | 108144555 | I723667 | 2019-12-05 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2039-12-04 |
| 光線照射角度偵測裝置及其方法 | 台灣 | 110148215 | I815253 | 2021-12-22 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2041-12-21 |
| 一種含校正感測器的四象限雙軸太陽感測器 | 美國 | 17/699,695 | US 12,216,001 B2 | 2022-03-21 | 2025-02-04 | 2022-03-21 | 2042-03-21 |
| 光線照射角度檢出裝置及びその方法 | 日本 | JP2022-018918 | 特許 7266919 | 2022-02-09 | 2023-04-21 | 2022-02-09 | 2042-02-09 |
| 微型化超穎材料結構的電感增益模組及其裝置 | 台灣 | 111106321 | I802285 | 2022-02-22 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2042-02-21 |
| INDUCTIVE MODULE AND DEVICE | 美國 | 17/884,927 | US 11,742,697 B1 | 2022-08-10 | 2023-08-29 | 2022-08-10 | 2042-08-10 |
| 用於降低資料維度的裝置及方法、用於轉換資料維度的裝置的操作方法 | 台灣 | 110147292 | I771250 | 2021-12-16 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2041-12-15 |
| 轉印頭結構以及使用該轉印頭結構之轉印系統 | 台灣 | 110147936 | I792792 | 2021-12-21 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 2041-12-20 |
| 利用三維重建地圖搜尋路徑之方法 | 台灣 | 111106361 | I809727 | 2022-02-22 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2042-02-21 |
| 多位元類比式乘法累加電路系統 | 台灣 | 111146007 | I850885 | 2022-11-30 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2042-11-29 |
| 可調節光源的光療裝置 | 台灣 | 112113516 | I826303 | 2023-04-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2043-04-10 |
| 具深度資訊之影像感測晶片 | 台灣 | 111140148 | I836678 | 2022-10-22 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2042-10-21 |
| IMAGE SENSORS CHIP WITH DEPTH INFORMATION | 美國 | 18/191,714 | US 12,192,661 B2 | 2023-03-28 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2043-03-28 |
| 具深度資訊之影像感測晶片 | 日本 | JP2023-093602 | 特許 7657258 | 2023-06-07 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2043-06-07 |
| 半導體元件及其製造方法 | 台灣 | 112102726 | I838099 | 2023-01-19 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2043-01-18 |
| 發光裝置及其製造方法 | 台灣 | 111127619 | I805457 | 2022-07-22 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2042-07-21 |

| 專利名稱 | 國別 | 申請號 | 證書號 | 申請日 | 取證日 | 專利有效期限(起) | 專利有效期限(迄) |
|--|----|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 電控液晶透鏡及複合式電控液晶透鏡 | 台灣 | 111145684 | I817850 | 2022-11-29 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2042-11-28 |
| ELECTRICALLY TUNABLE LIQUID CRYSTAL LENS AND COMPOSITE ELECTRICALLY TUNABLE LIQUID CRYSTAL LENS INCLUDING THE SAME | 美國 | 18/333,160 | US 12,085,834 B2 | 2023-06-12 | 2024-09-10 | 2023-06-12 | 2043-06-17 |
| MOCVD METHOD FOR GROWING INALGAN/GAN HETEROSTRUCTUR | 美國 | 18/094,836 | US 12,347,678 B2 | 2023-01-09 | 2025-07-01 | 2023-01-09 | 2044-03-20 |
| 感測紅外線之元件結構及感測紅外線之方法 | 台灣 | 112117232 | I859847 | 2023-03-01 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2043-05-08 |
| 增強型場效電晶體的製法 | 台灣 | 112123692 | I852648 | 2023-06-26 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 2043-06-25 |
| POWER DEVICE THRESHOLD VOLTAGE MEASUREMENT CIRCUIT AND OPERATION METHOD THEREOF | 美國 | 18/235,267 | US 12,523,694 B2 | 2023-08-17 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2044-09-04 |
| 功率元件臨界電壓量測電路及其操作方法 | 台灣 | 112133629 | I872683 | 2023-09-05 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2043-09-04 |

統計至115.3.16